# 附件一：《五轴采图平台-光学系统验收标准》

1. **项目背景**

本项目是为甲方定制一套基于五轴平台的光学方案，最终能够呈现手机中框各类型缺陷并输出缺陷图像。

1. **项目范围说明**

双方基于五轴采图平台项目展开合作，乙方需提供C#/C++ Demo采图程序、C++ 采图SDK、相机光学现场调试、Demo采图软件现场调试以及SDK开发指导等服务，使甲方能快速掌握Demo采图程序调试和SDK二次开发。

|  |  |
| --- | --- |
| **项目内容** | **说明** |
| 硬件 | 乙方提供相关采图硬件如下: |
| 功能要求 | 1. **Demo采图软件支持多个不同类型相机(面阵、线扫相机)。** 2. **Demo采图软件支持光源数字化控制。** 3. **Demo采图软件支持通信对接运动控制软件，并且可以根据通信协议自动切换不同光源配合不同相机采图。** 4. **Demo采图软件支持新建多个光学配方且每个配方都可以动态修改相机、光源、触发模式等参数。** 5. **Demo采图软件支持自动保存图像。** 6. **SDK 需将不同类型相机常用功能模块化封装并提供详细说明,最终可实现以上功能二次开发。** 7. **SDK支持多线程调用且相互不干扰。** 8. **光学系统需兼容多类型缺陷，缺陷定义如下:**   **PVD前清洗后(3D、RT面缺陷):抛光不足、碰刮伤、水印、脏污、发白、压伤**  **PVD前清洗后（侧面缺陷）:麻点、发蒙、Split金属发白、IO发白**  **抛光后(3D、RT面缺陷):抛光不足、碰刮伤、打磨纹、刀纹、**  **线纹、Split/IO金属线纹、Split金属发白、侧面碰压伤、砂轮纹、横纹、打砂纹、打砂痕、麻点、褶皱、料线、Split未见光、Split凹陷**   1. **在保证缺陷效果的前提下，乙方需配合甲方优化整机硬件方案且满足5s/pcs CT时间。** |
| * 验收标准 | **验证方法:**   * 1. **人工手动上下、翻转物料50次，配合五轴采图平台按照预设轨迹完成缺陷采图并且成像清晰。**   2. **人工可根据采图需求，动态配置采图点位 (涉及的参数都得开放操作界面)。**   **交付成果**   * **提供光学系统硬件(相机、镜头、光源、光源控制器)** * **提供Demo采图软件** * **提供面阵相机和线扫相机SDK详细说明文档** * **满足功能要求且具备可靠性** |

1. **协同控制**

协同控制至少应包含以下几点：

* 通过通信触发面阵相机、线扫相机
* 软件界面示警

1. **可移植性**

项目所涉及SDK接口需完全满足甲方提出二次开发要求。

1. **其他**

2022年 月 日前完成项目实施与整体项目调试工作。

乙方为甲方员工提供现场培训、使用说明书等。确保今后开发调试，甲方员工能够自主完成，乙方可以提供远程协助。

项目验收后乙方需辅助甲方参与材料整理与编写工作提供必要的支持。